## 중앙뉴스 (Korea)

## PMT places order for EV Group maskless lithography system - January 24, 2024

PMT has ordered a LITHOSCALE® maskless exposure system from EVG. Incorporating EVG's MLE™ (maskless exposure) technology, LITHOSCALE addresses lithography needs for markets and applications that require a high degree of flexibility or product variation. LITHOSCALE tackles legacy bottlenecks by combining powerful digital processing that enables real-time data transfer and immediate exposure, high structuring resolution and throughput scalability. It is ideally suited for rapid prototyping, providing fast turnaround and R&D cycle times.







패엠티(PROTEC MEMS Technology)와 EV그룹(EVG)이 삼단 웨이퍼 메모리 프로브 카드 제조를 위한 마스 크리스 리소그레피 궁급 계약을 제절했다. (왼쪽부터) 조랑호 패엠터 대표이사와 음영식 EVG 한국자사장 (제 궁=EV그룹)

파염티 조용호 대표이사는 "미세 피지 프로브 카드는 반복적인 리소그래피 패터닝 공정을 통해 제작돼 제 조 비용 증가 최소화가 필요하다"며 "기존의 마스크 얼라이너(Mask Aligner)를 이용한 리소그래피 공정을 EVG의 마스크리스(Maskless) 노광 장비인 LITHOSCALE로 대제함으로써 제소 비용의 절감이 가능하고 공정 개발 속도 또한 혁신적으로 단축 가능할 뿐 아니라 프로세스 성능도 더욱 항상할 수 있을 것으로 기대 하고 있다. 앞으로도 우리는 첨단 프로브 카드 제소 및 개발에 있어 EVG의 LITHOSCALE뿐 아니라 다양한 프로세스 솔루션을 통한 협력을 이어갈 것으로 기대한다"고 말했다.

EVG MLE(Maskless Exposure) 기술을 적용한 LITHOSCALE은 높은 수준의 유연성이나 제품 다양성을 필요로 하는 시장 및 애플리케이션의 리소그래피 요구를 충족한다.

LITHOSCALE은 실시간 데이터 전송과 즉각적인 노광을 가능하게 하는 강력한 디지털 프로세상 능력과 높은 구조적 분해능 및 생산 처리랑 확장성을 결합함으로써 기존 리소그래피 방식의 병목 문제를 해결한다. EVG의 LITHOSCALE은 신속한 프로토타입 개발에 때우 이상적인 솔루션으로서 턴어라운드 시간과 연구 개발 주기를 앞당길 수 있게 해준다.

EVG 윤영식 한국지사장은 '피엠티가 자사 제품 포트폴리오를 확장하고 개발 시간을 단속할 수 있도록 돕 게 돼 매우 기쁘다'며 '프로브 카드를 사용하는 웨이퍼 레벨 테스트는 디바이스 생산 수울을 높이고 다이당 전반적인 테스트 비용을 낮추기 위해서 필수적인 공정이다. LITHOSCALE은 높은 분해능, 다양한 많은 제 품 실계를 처리할 수 있는 뛰어난 유연성, 낮은 소유 비용 특성을 결합한 독창적인 솔루션으로서 미세 피지 웨이퍼 프로브 카드 제소용으로 매우 이상적'이라고 밝혔다.